

事前申込
参加費
不要

第9回 北海道大学

微小部・表面分析研究

ユーザーズミーティング

5/22(木)

10:30~17:00

【主催】 北海道大学工学研究院共同利用施設 複合量子ビーム超高压顕微解析研究室、
光電子分光分析研究室、ナノ・マイクロマテリアル分析研究室

【共催】 文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業 北海道大学・計測横断技術領域

【協賛】 日本金属学会北海道支部、日本鉄鋼協会北海道支部、日本分析化学会北海道支部、
日本顕微鏡学会北海道支部、日本電子株式会社、メイワフォーシス株式会社、XPSコミュニティ

＜会場＞

フロンティア応用科学研究棟
2階セミナー室

工

学研究院の共同利用施設では、表面・微小領域分析装置の一般開放を行っております。

装置はいずれも試料評価への強力なツールとなりますが、実際に使用する際には各装置の分析法の特徴を理解し、適切な選択を行うことが非常に重要となります。観察・分析技術の向上を目指し、ユーザーの皆様と施設職員の間で「材料分析に関するテクニカルな情報の共有化」を目的として、本ユーザーズミーティングを開催致します。

セミナー内容

＜ユーザーズ講演＞

10:35~10:50 「CO₂メタネーション用Ni触媒にAg₂CO₃を混合した際の効果と表面状態の変化」
北海道大学大学院工学研究院 修士1年 竹内 航平

10:50~11:05 「EBSD法によるTi₃SiC₂の結晶配向評価と変形挙動解析」
北海道大学大学院工学研究院 博士1年 清 英一

＜テクニカル講演 1＞

11:05~12:00 「ナノマテリアルにおける電子顕微鏡前処理技術の進化
ー最新断面加工装置による観察事例の紹介ー」
メイワフォーシス株式会社 古瀬 光明 氏

昼休憩 (12:00~13:00)

＜ユーザーズ招待講演＞

13:00~13:40 「ARIM微細加工/分析装置によって加速する核融合材料・光学材料研究」
自然科学研究機構 核融合科学研究所・准教授 上原 日和 先生

＜テクニカル講演 2＞

13:40~14:25 「EPMA-SXES(軟X線発光分光器)の御紹介 ー基本原理と活用事例ー」
日本電子株式会社 高倉 優 氏

休憩 (15分間)

14:40~15:15 「EDSの基礎と定量分析のコツ」(オンライン)
日本電子株式会社 溜池 あかね 氏

15:15~16:10 「TEMの原理からJEM-ARM200F NEOARMの特長まで」(オンライン)
日本電子株式会社 遠藤 徳明 氏

休憩 (15分間)

16:25~17:00 「オージェ電子分光法の基礎とアプリケーション」
日本電子株式会社 鍋島 冬樹 氏

セミナー開催中、
メイワフォーシス
株式会社の製品が
会場に展示されます！



最新鋭の機器を
実際にご覧頂けます。



セミナーの
概要一覧

オンライン(ZOOM)でも参加可能。
ハイブリッド形式での開催です。

URL : <https://x.gd/quyxl>
ミーティング ID : 812 8433 9568 パスコード : 320252



セミナー終了時にアンケートの
ご協力をお願いいたします。

アンケート回答はこちらのQRコードから ⇨
回答期限 : 2025年5月28日(水)



5/23(金)

日本電子株式会社 講演者による装置講習会を開催します。 対象装置 : AES, SXES

※詳細につきましては AES : 光電子分光分析研究室、SXES : ナノ・マイクロマテリアル分析研究室 へご連絡ください。

＊お問合せ先＊



複合量子ビーム超高压顕微解析研究室

TEL/FAX : 011-706-7300 Email : denken@eng.hokudai.ac.jp